کنترل پاشندگی سرعت گروه در سیستمهای لیزری تپکوتاه توسط بلورهای فوتونی یکبعدی شیری، رامین^{(۲}؛ صفری، ابراهیم^۱؛ بنانج، علیرضا^۲ ^{اگروه فیزیک اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز ۲ پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران}

چکیدہ

در این تحقیق، قابلیت بلورهای فوتونی یک بعدی جهت جبران پاشندگی سرعت گروه و درنتیجه فشردهسازی تپهای نوری فوق کوتاه در سیستمهای لیزری تپ کوتاه به صورت نظری مورد مطالعه قرار گرفته است. دو نوع ساختار چندلایهای ساده و مدرج متشکل از مواد دی الکتریک تیتانیا و سیلیکا با ضخامت و دوره تناوب یکسان مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. دو نوع ساختار مدرج با ضریب شکست تا دریجی، پروفایل ضریب شکست نمائی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که در ساختار دارای لایه مدرج، رفتار فشردهسازی بطور موثری بهبود می یابد. فاکتور فشردهسازی تا ۲۲٪ برای ساختار مدرج با پروفایل نمائی در این نوع ساختارها بهدست آمد.

Group velocity dispersion control in ultrashort-pulse laser systems by 1D photonic crystals

Shiri, Ramin^{1, 2}; Safari, Ebrahim¹; Bananej, Alireza²

¹ Department of Physics, University of Tabriz, Tabriz, ² Laser and Optics Research School, NSTRI, Tehran

Abstract

In this study, the capability of one-dimensional photonic crystals for dispersion compensation in ultrashortpulse laser systems have been theoretically investigated. Two types of simple and graded index multi-layer structures consisting alternating layers of TiO_2 and SiO_2 with the same total thicknesses and periodicity have been investigated and compared. For the graded structure, refractive index distribution with exponential profile have been considered. The results revealed that in the graded structure, compression behavior of the system efficiently improves. The compress factor of as much as 22% obtained with exponential profile of such the structures.

PACS No. 78.20

محدود می سازد پاشندگی ماده است که باعث می شود مولفه های فرکانسی مختلف تپ با سرعت های مختلفی در محیط منتشر شوند. این امر منجر به پاشندگی سرعت گروه می شود که پهن-شدگی زمانی تپ (چرپ) را به همراه دارد. روش های مرسوم جبران پاشندگی شامل استفاده از جفت منشور و جفت توری هستند [3–۳] که دارای معایب عمده ای از جمله عدم جبران اثرات پاشندگی های مراتب بالا [٥] و نیز نیاز به فواصل بزرگ جهت ایجاد پاشندگی مورد نیاز می باشند. بلورهای فوتونی کاندیدای

یکی از دستاوردهای عظیم فناوری لیزر در سالهای أخیر، بدون تردید توسعهی روشهای تولید و شکلدهی تپهای نوری فوق-کوتاه میباشد. تپهای فوقکوتاه لیزری بهخاطر کاربردهای گستردهشان در زمینههای متعدد [۲–۱] مورد توجه وسیعی می-باشند به همین دلیل، تولید تپهای لیزری با کمترین پهنای ممکن از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. یکی از مهمترین عواملی که کمترین پهنای قابل دسترس در سیستمهای لیزری تپکوتاه را

مقدمه

مناسبی برای کنترل پاشندگی در سیستمهای لیزری فمتوثانیه ای به-شمار می روند [٦]. این بلورها، ساختارهای تناوبی هستند که دارای گافنواری فوتونی می باشند [۷]. ثابت شده است که چنین ساختارهای فوتونی دارای رفتار پاشندگی شدیدی در نزدیکی لبهی گافنواری می باشند [۸]. در این کار، برای ساختار ساده از لایه-های متناوب تیتانیا و سیلیکا استفاده شده و رفتار فشرده سازی آن ناحیه طیفی مادون قرمز نزدیک مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان ساختار دوم، یکی از لایه های سلول واحد در ساختار ساده، با لایه ای دارای ضریب شکست تدریجی با پروفایل نمایی جایگزین شده است. نشان داده شد که توانایی یک بلور فوتونی یک بعدی دارای لایه یا ضریب شکست تدریجی به عنوان یک

تئورى

طرح شماتیکی یک بلور فوتونی یک بعدی ساده و تدریجی در شکل ۱ نشان داده شده است. ما در اینجا از تیتانیا (A) و سیلیکا (B) بهترتیب بهعنوان مواد با ضرایب شکست بالا (nA=۲/0) و پایین (nB=۱/0) با ضخامتهای Ab و db استفاده نمودهایم. فرض ما بر این است که نور در راستای محور z منتشر می شود و برای محاسبه ضرایب عبور و بازتاب کل ساختار، از روش ماتریس انتقال [۹] استفاده میکنیم. ماتریس انتقال ساختار که دامنههای امواج در سمت چپ و راست بلور را به هم مرتبط می سازد بشکل زیر نوشته می شود:

$$M = \begin{pmatrix} M_{11} & M_{17} \\ M_{71} & M_{77} \end{pmatrix} = D_{\cdot}^{-1} \left[\prod_{j=1}^{N} D_j P_j D_j^{-1} \right] D_s$$
(1)

که در آن P ماتریس انتشار و D ماتریس دینامیکی برای موج TE بصورت زیر تعریف می شوند:

 $P_{j} = \begin{pmatrix} e^{i\{j} & \cdot \\ \cdot & e^{-i\{j} \end{pmatrix}, D_{j} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ n_{j} \cos_{\pi j} & -n_{j} \cos_{\pi j} \end{pmatrix} (Y)$ $\sum_{j=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \sum_{$





شکل ۱: ساختار بلور فوتونی یکبعدی متشکل از مواد دیالکتریک A و B به-عنوان مواد با ضرایب شکست بالا و پایین (الف) ساده (ب) تدریجی

مولفه x بردار موج در هر لایه بشکل زیر نوشته میشود:

$$k_{jx} = n_j \frac{S}{c} \cos_{w_j} \tag{(7)}$$

فرض شده است که ضریب شکست لایه تدریجی از مقدار کمینهی است است ا مقدار بیشینهی ۲/۵ تغییر میکند. بجای یک لایهی منفرد با چنین مشخصهای، ما از ۹ لایهی کوچکتر با همان ضخامت کل که ضریب شکست آنها بطور نمایی در لایه وسط به ماکزیمم رسیده و سپس با همان شیب در لایهی آخر به مینیمم میرسد استفاده نمودیم. چنین لایههای تدریجی را میتوان با میرسد استفاده نمودیم. چنین لایههای تدریجی را میتوان با ترکیب تیتانیا (TiO2) و سیلیکا (SiO2) و سپس تغییر نسبت حجمی آنها که با x در ماده ترکیبی x-۱(SiO2) نمایش داده میشود ایجاد کرد [۱۰]. برای توصیف پروفایل نمائی مورد استفاده در لایه تدریجی با ضخامت L از تابع زیر استفاده شده است [۱۱]:

$$n = \begin{cases} \frac{en_{\min} - n_{\max}}{-1 + e} - \frac{n_{\min} - n_{\max}}{-1 + e} e^{\tau_{X}/L}, & \cdot < z < \frac{L}{\tau} \\ \frac{en_{\min} - n_{\max}}{-1 + e} - \frac{e^{\tau}(n_{\min} - n_{\max})}{-1 + e} e^{-\tau_{X}/L}, & \frac{L}{\tau} < z < L \end{cases}$$

$$(\epsilon)$$

با استفاده از رابطه فوق، می توان فاز موج عبوری، ا¢، را بهراحتی بهدست آورد. فرض می کنیم که تپ لیزری فرودی (با طول موج مرکزی ۸۰۰ نانومتر) دارای پروفایل شدت گوسی بوده و بهخاطر پاشندگی مثبت ماده، دارای چرپ اولیه مثبت می باشد. در انتشار موج در محیط تناوبی خطی همواره می توان تپ لیزری را بصورت جمع مولفه های فوریه ای آن بشکل زیر نوشت:

 $\vec{E}(\vec{r},t) = \int d\vec{k} \int d\breve{S} \vec{E}(k,\breve{S},z) e^{i(\vec{k}.\vec{r}-\breve{S}t)}$ (7) که (\vec{r},x,y ترداری دوبعدی در صفحه ورودی ساختار میباشد. وقتی چنین تپی در داخل بلور فوتونی در راستای Z منتشر میشود پهنای زمانی آن در چارچوب پاشندگی مرتبهی ۲ مطابق رابطه زیر تغییر خواهد کرد [۱۳]:

$$\ddagger_{p}(\mathbf{z}) = \ddagger_{\cdot} \sqrt{(1 - \Gamma_{\cdot} k_{\gamma} \mathbf{z})^{\gamma} + (k_{\gamma} \mathbf{z}/\ddagger_{\cdot})^{\gamma}}$$
(v)

که در آن، $\frac{\partial' k}{\partial \breve{S}^{\gamma}} = k_{\gamma}$ پاشندگی سرعت گروه، r_{\cdot} آهنگ چرپ اولیه تپ و ξ_{γ} بهنای زمانی آن میباشد.

نتايج و بحث

در این تحقیق، رفتار فشردهسازی دو نوع ساختار تناوبی یک-بعدی در ناحیه طیفی مادونقرمز نزدیک با استفاده از نرمافزار متلب بطور عددی مورد ارزیابی و شبیهسازی قرار گرفت. هر دو ساختار شامل N جفت لایهی متناوب از مواد دیالکتریک تیتانیا و سیلیکا بهترتیب بهعنوان مواد با ضرایب شکست بالا (A) و پایین (B) بهده و دارای شکل کلی ^N(AB) و ^N(B*A) میباشند که*A نمایانگر لایهی با ضریب تدریجی و N تعداد سلولهای واحد نمایانگر لایهی با ضریب تدریجی و N تعداد سلولهای واحد است. پارامترهای ساختار بهشکل زیر در نظر گرفته شد: مدیجی

متشکل از چندین لایهی همگن با ضخامت یکسان میباشد که ما در اینجا ۹ لایه با ضخامت ۵۰ نانومتر در نظر گرفتیم. طیف بازتاب و منحنی پاشندگی سرعت گروه برای ساختار ساده مورد مطالعه در شکلهای ۲ و ۳ نشان داده شده است. منحنی پاشندگی شکل ۳ بر اساس محاسبهی فاز تپ خروجی و مشتق دوم آن نسبت به فرکانس رسم شده است. مطابق شکل ۲، طولموج مرکزی تپ مورد مطالعه (۸۰۰ نانومتر) در نزدیکی لبهی گافنواری قرار گرفته است جایی که در آن پاشندگی ساختار قابل ملاحظه میباشد.



شکل ۲: طیف عبور و بازتاب بلور فوتونی یک-بعدی ساده بر حسب طولموج

تحت تابش عمودی و تعداد جفت لایه ی N=15. بالی فشرده سازی برای چرب منفی برای چرب منفی ۲۰/۱ ۲

شکل ۳: منحنی پاشندگی سرعت گروه بر حسب طولموج. نواحی فشردهسازی برای چرپهای مثبت و منفی نشان داده شده است.

لذا همانطور که از شکل ۳ نیز پیداست، انتظار داریم چنین تپ نوری در اثر عبور از ساختار مورد نظر پاشندگی سرعت گروه منفی را تجربه کرده و در نتیجه فشرده گردد. در این مقاله، تپ نوری با آهنگ چرپ اولیهی ^۲,‡/۳– = ۲ با پهنای زمانی ۱۰۰ فمتوثانیه مورد مطالعه قرار گرفته است. همانطور که در شکل ٤ دیده می-شود میزان فشردهشدگی این تپ در عبور از ساختارهای ذکر شده

متفاوت میباشند. بر طبق شکل ٤ الف ملاحظه میکنیم که بلور فوتونی ساده تأثیر چندانی بر پهنای زمانی تپ نمیگذارد در حالی-که در ساختار تدریجی (شکل ٤ ب) تپ در حین انتشار فشرده می شود.



شکل ٤: فشرده شدگی تپ نوری با ``,‡/۳ – = ۲ و r و r او r = .1 در عبور از یک بلور فوتونی (الف) ساده و (ب) تدریجی نمایی تحت تابش عمودی. مطابق شکل ٤، در حالت بلور فوتونی ساده، تپ اولیه با پهنای ۱۰۰ فمتوثانیه تا مقدار ۹۳ فمتوثانیه در فاصله ۱۵ میکرون داخل محیط فشرده می شود. برای پروفایل نمائی (شکل ٤٠)، تپ اولیه در فاصله ۱۵ میکرون تا پهنای ٤٨ فمتوثانیه فشرده شده است. از آنجایی که ضخامت کل ساختارها ١٤ میکرون در نظر گرفته شده است لذا باید پارامترهای تپ و ساختار به گونهای انتخاب گردند شود. نتایج نشان داد که برای آهنگ چرپ ``,‡/۳ – = .۲، پهناهای خروجی تپ برای ساختارهای ساده و نمائی به ترتیب عبارت شود. نتایج نشان داد که برای آهنگ چرپ `,‡/۳ – = .۲، پهناهای نخروجی تپ در ای ساختارهای ساده و نمائی به ترتیب عبارت است از ٤٢ و ۸۸ فمتوثانیه. جهت مقایسه کارآیی فشرده سازی دو ساختار، پهنای تپ در فواصل مختلف داخل محیط و نیز در نقطه ساختار، پهنای تپ در فواصل مختلف داخل محیط و نیز در نقطه کدام مطابق رابطه زیر محاسبه می کنیم:

$$F = \frac{\ddagger}{\ddagger}, \tag{(A)}$$

که .‡ و به ترتیب نشان دهندهی پهنای اولیه و پهنای تپ در داخل محیط میباشند. در شکل ۵، نمودار فاکتور فشردگی بر حسب فاصله برای هر دو ساختار نشان داده شده است.



شکل ۵: فاکتور فشردگی برای بلور فوتونی ساده و تدریجی با پروفایل نمائی. دادههای داخل دایره مربوط به پهنای تپ در خروجی ساختارها میباشند.

نتيجهگيري

رفتار فشردهسازی بلورهای فوتونی یکبعدی با و بدون لایهی تدریجی برای تپهای ۱۰۰ فمتوثانیهای با طولموج مرکزی ۸۰۰ نانومتر در ناحیه طیفی مادونقرمز نزدیک شبیهسازی و مورد مقایسه قرار گرفت. برای ضریب شکست لایهی تدریجی، پروفایل نمایی بهکار گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از لایهی تدریجی در ساختار بلور فوتونی، کارآیی فشردهسازی را بهطور موثری بهبود می بخشد. فاکتور فشردهسازی تا ۲۲٪ برای تپهای با چرپ اولیه ^۲, ‡/۳ – = ۲ با ساختار تدریجی دارای پروفایل نمائی به دست آمد.

مرجعها

- [] S. H. Shim and M. T. Zanni; Phys. Chem. Chem. Phys. 11, (2009) 748.
-] Y. Silberberg; Annu. Rev. Phys. Chem. 60, (2009) 277.
-] R. L. Fork, O. E. Martinez and J. P. Gordon; *Opt. Lett.* 9, (1984) 150.
-] D. Strickland and G. Mourou; Opt. Comm., 56, (1985) 219.
-] F. Krausz, et al.; *IEEE J. Quantum Electron.* **28**, (1992) 2097.
-] A. Belardini, et al.; *Appl. Phys. Lett.* **89**, (2006a) 031111.
- Yablonovitch E.; J. Opt. Soc. Am. B 10, (1993) 283.
 A. Yariv, P. Yeh; J. Opt. Soc. Am. 67, (1977) 438.
- [] J.B. Pendry; Adv. Phys. 43, (1994) 461.
- Noemaun, et al.; *J. Vac. Sci. Tech. A*, **29**, (2011) 051302.
-] N. B. Pleshchinskii and D. N. Tumakov; Proceedings of the Progress
- in Electromagnetics Research Symposium (PIERS'12) (2012).
 C.C. Katsidis, D.I. Siapkas; *App. Opt.*, **41**, (2002) 3978.
- [] A. Akhmanov, V.A. Vysloukh; *Am. Inst. Phys.*, New York (1992).